pn结

复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

June 16, 2015

Contents

1	平衡	ipn结	3
	1.1	pn结的形成	3
	1.2	空间电荷区	3
	1.3	平衡结中费米能级	4
	1.4	pn结接触电势差	4
	1.5	pn结载流子分布	5
2	pn结	吉电流电压特性	6
	2.1	平衡pn结静电特性	6
	2.2	非平衡pn结能带图	7
	2.3	理想pn结的J-V特性	8
	2.4	非理想pn结	9
3	pn结	结电容	11
	3.1	势垒电容	11

	3.2	扩散电容	11
4	pn约	结击穿	12
	4.1	雪崩击穿	12
	4.2	齐纳击穿	12
	4.3	两种击穿比较	13
5	隊道	效应	13

1 平衡pn结

1.1 pn结的形成

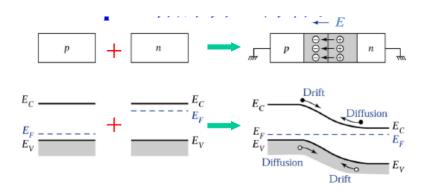


Figure 1: pn结的形成

• 突变结 载流子浓度高, 较浅

$$x < x_j, N(x) = N_A - N_D; \quad x > x_j, N(x) = N_D$$

 $N_A >> N_D \to p^+ - n \ \text{fi} \quad N_D >> N_A n^+ - p \ \text{fi}$

• 缓变结 载流子浓度低,较深 $N_D-N_A=lpha_j(x-x_j)$

1.2 空间电荷区

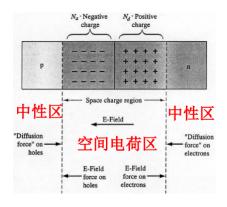


Figure 2: pn结的结构

载流子浓度梯度⇒扩散⇒破坏电中性⇒ 自建电场⇒漂移电流⇒动态平衡⇒零净电流 $J_n = J_{n,diff} + J_{n,drift} = 0, J_p = J_{p,diff} + J_{p,drift} = 0$

1.3 平衡结中费米能级

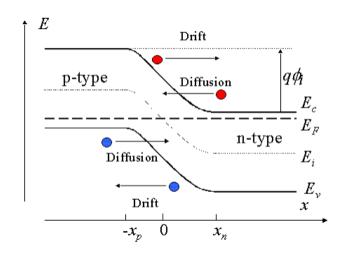


Figure 3: 平衡pn结能带图

平衡结中费米能级为一条直线, 推导如下:

1.4 pn结接触电势差

$$\therefore qV_D = E_{F(n)} - E_{F(p)}$$

$$\begin{cases} E_{F(n)} = E_i + kTln(N_D/n_i) \\ E_{F(p)} = E_i - kTln(N_A/n_i) \end{cases}$$

$$\therefore V_D = \frac{kT}{q}ln\left(\frac{N_AN_D}{n_i^2}\right)$$

1.5 pn结载流子分布

 n_{n0} :电中性n型区的电子浓度 p_{p0} :电中性p型区的空穴浓度 n_{p0} :电中性p型区的电子浓度 p_{n0} :电中性n型区的空穴浓度

$$n(x) = n_{p0}exp\left(rac{qV(x)}{kT}
ight)$$
 , $p(x) = p_{p0}exp\left(-rac{qV(x)}{kT}
ight)$

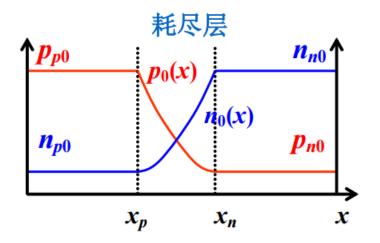


Figure 4: 平衡pn结载流子分布

耗尽层近似 势垒区中全部载流子被耗尽,可忽略

2 pn结电流电压特性

2.1 平衡pn结静电特性

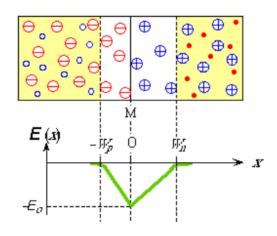


Figure 5: pn结电场分布

思路:

利用耗尽层近似求出空间电荷密度 $\rho(x)$

利用泊松方程积分 $\rho(x)$ 求出E(x)

对E(x)积分求出V(x)

由玻尔兹曼统计得到n(x)

对于突变结 p^+n

电荷分布

$$\rho(x) = q(N_D + N_A + p - n) = \begin{cases} \rho(x) = -qN_A, -x_p \le x \le 0\\ \rho(x) = qN_D, 0 \le x \le x_n \end{cases}$$

泊松方程

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_0\varepsilon_r} = -\frac{dE}{dx}$$

边界条件

$$E(-x_p) = E(x_n) = 0$$

$$V(-x_p) = 0, V(x_n 0) = V_D$$

$$\therefore E(x) = \int \frac{\rho(x)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} dx$$

$$E_p(x) = -\frac{qN_A}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} (x + x_p), E_n(x) = -\frac{qN_D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} (x_n - x)$$

$$\therefore V(x) = -\int E(x)dx$$

$$V_p(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_0\varepsilon_r}(x+x_p)^2, V_n(x) = V_D - \frac{qN_D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}(x-x_n)^2$$
 $x = 0$ 处,电场强度最大
$$E_M = -\frac{qN_A}{\varepsilon_0\varepsilon_r}x_p = -\frac{qN_D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}x_n$$
 $\therefore \frac{x_n}{x_n} = \frac{N_A}{N_D}$ (正负电荷总量相等)

$$x = 0$$
处, $V_p(x) = V_n(x)$
$$V_D = \frac{qN_A}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}x_p^2 + \frac{qN_D}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}x_n^2$$

$$\therefore X_D = x_p + x_n, \frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

$$\therefore X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r(N_A + N_D)V_D}{qN_AN_D}}$$

$$p^+n: X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_rV_D}{qN_D}} \approx x_n; \qquad n^+p: X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_rV_D}{qN_A}} \approx x_p$$

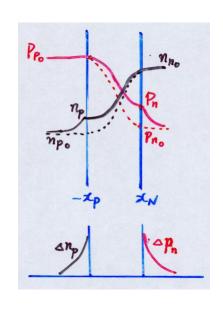
对于线性缓变结的求解思路相同

2.2 非平衡pn结能带图

正偏压下,势垒降低,变窄;反偏压下,势垒升高,变宽 一般只考虑正偏压:

• 势垒高度降低为 $q(V_D-V)$

• $I_{diff} > I_{drift}$,少子注入p区和n区



• 不存在统一费米能级

Figure 6: 正偏压下浓度的变化

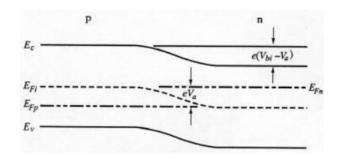


Figure 7: 正偏压下能带图

2.3 理想pn结的J-V特性

前提条件:

- 小注入条件: 注入的少子浓度比平衡多子浓度小得多
- 突变耗尽层条件:耗尽层中载流子浓度非常小,外加电压和接触电势差多数降在耗尽层上
- 通过耗尽层的电子和空穴电流为常量,不考虑载流子在耗尽层中的产生和复合
- 忽略扩散区和中性区的电场和电压
- 玻尔兹曼边界条件: 在耗尽层两端, 载流子分布满足玻尔兹曼统计分布

$$J = J_p(x_n) + J_n(x_n)$$

若通过空间电荷区不发生复合, $J = J_p(x_n) + J_n(x_p)$

又由一维稳定扩散情况
$$J = \frac{qD_p}{L_p} \Delta p(x_n) + \frac{qD_n}{L_n} \Delta n(x_p)$$

解连续性方程,得 $\Delta p(x_n) = p_{n0}(e^{\frac{qV}{kT}} - 1), \Delta n(x_p) = n_{p0}(e^{\frac{qV}{kT}} - 1),$

令
$$J_s = \left(\frac{qD_pp_{n0}}{L_p} + \frac{qD_nn_{p0}}{L_n}\right)$$
 , 得到shockley equation $J = J_s \left[exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1\right]$

Law of Junction:

$$p_{zone} = n_i exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{k_B T}\right)$$
, $n_{zone} = n_i exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{k_B T}\right)$

在p区、n区、空间电荷区都适用

PS:空间电荷区中

$$\therefore qV = E_{Fn} - E_{Fp} \therefore pn = n_i^2 exp\left(\frac{qV}{k_BT}\right)$$

2.4 非理想pn结

势垒区的产生与复合 复合率

$$U = \frac{N_t r(np - n_i^2)}{n + p + 2n_i}, np = n_i^2 exp\left(\frac{E_F^n - E_F^p}{k_B T} = n_i^2 exp(qV/k_B T)\right)$$

- 正偏压下, $n=p=n_i^2 exp(qv/2k_BT)$

$$\therefore U = \frac{n_i}{2\tau} \frac{exp\left(\frac{qV}{k_BT} - 1\right)}{exp\left(\frac{qV}{2k_BT} - 1\right)} = \frac{n_i}{2\tau} exp\left(\frac{qV}{2k_BT}\right)$$

$$\therefore J_r = \int_{-x_p}^{x_n} qU dx = \frac{qn_i X_D}{2\tau} exp\left(\frac{qV}{2kT}\right)$$
又扩散电流 $J_{fd} = \frac{qD_p n_i^2}{L_p N_D} exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$

$$\therefore \frac{J_{fd}}{L_r} \propto \frac{2n_i L_p}{N_D X_D} exp\left(\frac{qV}{2kT}\right)$$

小电压时,复合电流起主要作用;大电压时,扩散电流起主要作用

J-V经验公式

$$J_f \propto exp\left(rac{qV}{mk_BT}
ight)$$
,理想因子 $m: 1 \sim 2$

- 反偏压下 $n \approx p \approx 0$,

$$\therefore U = \frac{n_i}{2\tau}$$

$$\therefore J_G = \int_{-x_p}^{x_n} qU dx = \frac{qn_i}{2\tau} X_D$$

$$\frac{J_{rd}}{J_G} = 2 \frac{n_i}{N_D} \frac{L_p}{X_D} \quad 室温下 J_G >> J_{rd}$$

温度升高,少子寿命降低,禁带宽度变小,都会导致 I_G 增加,即反向电流增加

• 大注入条件

$$n_{n0} = N_D = n_i$$

$$J_p = q\mu_p p_n(x_n) E(x_n) - qD_p \frac{d\Delta p_n(x)}{dx}$$

$$J_{n} = q\mu_{n}n_{n}(x_{n})E(x_{n}) + qD_{n}\frac{d\Delta n_{n}(x)}{dx}$$
內建电场 $J_{n} = 0$, $E(x_{n}) = -\frac{D_{n}}{\mu_{n}}\frac{1}{n_{n}(x_{n})}\frac{d\Delta n_{n}(x)}{dx}$

$$\therefore J_{p} = -qD_{p}\left[1 + \frac{p_{n}(x_{n})}{n_{n}(x_{n})}\right]\frac{d\Delta p_{n}(x)}{dx} = -2qD_{p}\frac{d\Delta p_{n}(x)}{dx}$$

$$\therefore p_{n}n_{n} = n_{i}^{2}exp(qV/k_{B}T), p_{n} \approx n_{n}$$

$$\therefore p_{n}(x_{n}) = n_{i}exp(qV/2k_{B}T)$$

$$\therefore J_{f} = 2qD_{p}\frac{n_{i}}{L_{p}}exp(qV/2k_{B}T)$$

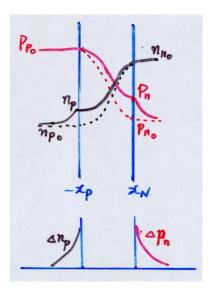


Figure 8: 正偏压下能带图

在 p^+n 结的大注入条件下,电子的扩散电流与漂移电流大小相等,方向相反而相互抵消;

在正向电流密度中,空穴扩散电流和空穴 漂移电流大小相等,方向相同,使得总空 穴电流是扩散电流的两倍。

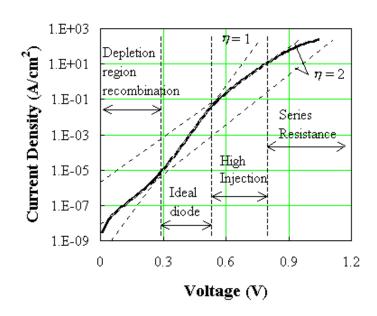


Figure 9: 非理想pn结总结

3 pn结电容

3.1 势垒电容

产生原因:空间电荷区厚度发生变化突变结:

若为突变结,令N_R为轻掺杂浓度

$$C_T = A\sqrt{\frac{q\varepsilon_0\varepsilon_r N_B}{2(V_D - V)}}$$

若考虑势垒区的载流子作用

$$C_T = 4C_T(0) = 4A\sqrt{\frac{q\varepsilon_0\varepsilon_r N_A N_D}{2(N_A + N_D)V_D}}$$

对于线性缓变结,思路相同,只是 X_D 不同

$$C_T = \frac{dQ}{dV} = A \left[\frac{q\alpha_j \varepsilon_0^2 \varepsilon_r^2}{12(V_D - V)} \right]^{1/3} = \frac{A\varepsilon_0 \varepsilon_r}{X_D}$$

无论杂质如何分布,在一定反向偏压下的微分电容,都可以等效为一个平行板电容器的电容。

3.2 扩散电容

在正向偏压下,空间电荷区外扩散长度范围内存贮有过剩载流子 $\Delta n \Delta p$,这些电荷的存贮量是随正向偏压增加的,这部分电容效应成为扩散电容。

対干N区

$$\Delta p(x) = p_{n0} \left[exp \left(\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right] exp \left(-\frac{x - x_n}{Lp} \right)$$

$$\therefore Q_p = Ae \int_{x_n}^{\infty} \Delta p(x) dx = AqL_p p_{n0} \left[exp \left(\frac{qV}{kT} \right) - 1 \right]$$

$$\therefore C_{dp} = \frac{dQ_p}{dV} = A \frac{q^2 L_p p_{n0}}{kT} exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$$

$$P \boxtimes C_{dn} = \frac{dQ_n}{dV} = A \frac{q^2 L_n n_{p0}}{kT} exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$$

$$\therefore C_d = C_{dp} + C_{dn} = \left[Aq^2 \frac{(n_{p0} Ln + p_{n0} Lp)}{kT}\right] exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$$

4 pn结击穿

4.1 雪崩击穿

在高反偏的p-n结势垒区中电场很强,载流子在强电场下将获得很大的动能,会发生碰撞电离而激发出新的电子一空穴对,并持续下去

估算击穿电压: 即为E-x关系图所围成面积

突变结:
$$V_{BR} = \frac{1}{2}E_c \cdot X_D = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2q} \frac{E_C^2}{N_B}$$

缓变结:
$$V_{BR} = \left(\frac{32\varepsilon_0\varepsilon_r E_c^3}{9\alpha_j q}\right)^{1/2}$$

雪崩击穿具有正的温度系数 随着温度的增加,半导体晶格振动加强,载流子与晶格碰撞 几率增加,从而因碰撞而损失的能量也就增加。因此要达到碰撞所需的能量,必须有更强的 电场。

4.2 齐纳击穿

在两边都重掺杂的pn结中是主要的击穿机制。当反向偏压很高时,p区的价带顶高于N区的导带底。当价带电子所需越过的势垒宽度d=Eg/qE 时,价带电子可以直接隧穿到导带

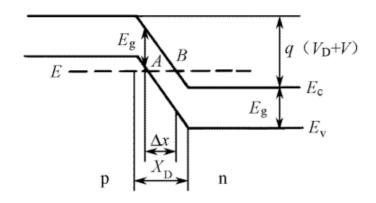


Figure 10: 齐纳击穿

隊穿几率
$$P=exp\left[-rac{8\pi}{3}\left(rac{2m_n^*}{h^2}
ight)^{1/2}E_g^{1/2}\Delta x
ight]$$

其中 $\Delta x=rac{E_g}{q}\left(rac{2\varepsilon_0\varepsilon_r}{q}rac{1}{N_{eff}V_r}
ight)^{1/2}$, $N_{eff}=rac{N_DN_A}{N_D+N_A}$

4.3 两种击穿比较

	雪崩击穿	齐纳击穿
掺杂浓度	低 ;N↑,E _B ↑	高;N↑,E _B ↓
$E_{\mathcal{g}}$	$E_g \uparrow, E_B \uparrow (V_{BR} > 6E_g/q)$	$E_g \uparrow, E_B \uparrow (V_{BR} < 4E_g/q)$
温度关系	$T\uparrow$, $E_B\uparrow$	$T \uparrow, E_g \downarrow, E_B \downarrow$
隧道长度	d大利于雪崩击穿	d小利于齐纳击穿

5 隧道效应

- 简并半导体的费米能级可以在导带顶上,也可以在价带底下
- **江崎二极管**结一边的导带电子直接通过隧道效应穿透到对面的价带(或相反),这个过程称为pn结中的隧道效应,这种效应只涉及到两个带中多子数量的变化,不会造成载流子的非平衡积累
- 江崎二极管具有负阻区